

INŻYNIERIA POWŁOK W SKALI NANO – ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ELEKTRONIKI

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium oraz warsztatach organizowanych wspólnie przez firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Instytut Fizyki PAN. Podczas wydarzenia będziecie mogli Państwo posłuchać wykładów specjalistów aplikacyjnych i zetknąć się z systemami projektowanymi i produkowanymi przez wymienione firmy:

- **TFS 200** służącym do osadzania warstw atomowych (ang. ALD), prod. Beneq
- **FlexAL** służącym do osadzania warstw atomowych (ang. ALD), prod. Oxford Instruments
- **PlasmaPro 100 Cobra** służącym do ICP CVD oraz ICP RIE, prod. Oxford Instruments
- **nanoPVD-S10A** służącym do PVD, prod. Moorfield Nanotechnology
- **nanoCVD-8G** służącym do wytwarzania grafenu oraz nanorurek węglowych, prod. Moorfield Nanotechnology
- profilometrem optycznym **Profilm3D**, prod. Filmetrics
- **F3-sX**, służącym do pomiaru grubości i reflektancji wafli krzemowych, grubszych warstw fotorezystów, powłok ochronnych, oraz analizy błędów w produkcji zintegrowanych obwodów, prod. Filmetrics
- **F40-UVX**, służącym do pomiaru grubości i reflektancji warstw półprzewodnikowych, MEMS, LCD, prod. Filmetrics
- **F20-UV**, służącym do pomiaru grubości, reflektancji i transmitancji warstw półprzewodnikowych, OLED, ITO, prod. Filmetrics
- profilometrem optycznym **DCM8**, prod. Leica
- **robotami do mikroskopii**, prod. Imina Technologies
- **mikroskopem SEM**, prod. Phenom World
- **elipsometrem SE-1000** prod. Semilab

PROGRAM

Seminarium odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r. w budynku Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy alei Lotników 32/46.

Plan zostanie udostępniony w połowie października.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Dla uczestników przewidziano poczęstunek z kawą oraz obiad na miejscu. Dodatkowo na zakończenie pierwszego dnia po sesji plakatowej odbędzie się wspólna kolacja.

SESJA PLAKATOWA

Podczas seminarium zostanie również zorganizowana sesja posterowo-dyskusyjna – otwarta dla wszystkich chętnych. W trakcie sesji uczestnicy będą mogli podzielić się dokładną tematyką swoich badań (w formie posteru, prezentacji), przedyskutować je z pozostałymi uczestnikami oraz prelegentami. Udział w sesji jest dobrowolny.

ZAPISY

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie warsztatów - <http://technolutions.pl/pl/inzynieria-powlok-w-skali-nano/>